

八戸工業研究所所有装置

名称	白色光共焦点顕微鏡	メーカー	レーザーテック(株)	型式	OPTELICS_HY BRID_L7	取得	H26
概要	金属やプラスチック等様々な材料の表面状態を、白色光を含む最適な波長で観察する事により高分解能の顕微鏡観察が可能です。また、光干渉原理における3次元測定機能、微分干渉観察、反射分光膜厚測定機能により、高精度な表面形状、寸法の計測が可能です。						
応用事例	<ul style="list-style-type: none"> ・表面状態観察と部品寸法計測の同時測定 ・透明材料の膜厚測定 ・部品の平坦度、粗さ測定 						
主な仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・光源:キセノンランプ/405nmレーザー ・計測高さの正確さ: $(\pm 0.02 \times 100 / \text{対物レンズ倍率} + L / 1000) \mu\text{m}$ ・計測幅の正確さ: $(\pm 0.011 + L / 100) \mu\text{m}$ NA 0.9以上の対物レンズ ・光干渉測定機能:位相シフト干渉測定、ノマルスキー微分干渉観察、反射分光膜厚測定 ・冷却加熱ステージ(-160*液体窒素~600°C) 						
測定時間	観察 5分~	 <p>工具の表面形状計測</p>					
出力形態	JPG、BMP等の画像ファイル						
試料等の制約	<ul style="list-style-type: none"> ・顕微鏡のステージにおけること (ステージサイズ200×200) 高さ70mm以下 重さ約1kg程度 ・動くもの、流動性のあるもの観察は難しい。 						
使用料 手数料	機械使用: 2,950 円/時間 依頼試験: 観察のみ 1,500 円/件、計測をおこなうもの 3,050 円/件、写真 210 円/枚						
機械使用予約・お問い合わせ 八戸工業研究所 技術支援部 TEL: 0178-21-2100, FAX: 0178-21-2101 e-mail: kou_hachinohe@aomori-itc.or.jp 本装置は地域オープンイノベーション促進事業(東北地域:経済産業省)により導入しました。							